Bulk MOSFET と SOTB MOSFET におけるランダムテレグラフノイズ(RTN)の統計分布比較

Comparison of Statistical Distribution of Random Telegraph Noise (RTN) in Bulk and SOTB MOSFETs 東大生研¹, LEAP²^O古峰祐樹¹, 水谷朋子¹, 山本芳樹², 槇山秀樹², 山下朋弘², 尾田秀一², 蒲原史朗², 杉井信之², 更屋拓哉¹, 小林正治¹, 平本俊郎¹

IIS, The University of Tokyo¹, LEAP², ^OYuki Komine, Tomoko Mizutani, Yoshiki Yamamoto², Hideki Makiyama², Tomohiro Yamashita², Hidekazu Oda², Shiro Kamohara², Nobuyuki Sugii², Takuya Saraya, Masaharu Kobayashi, and Toshiro Hiramoto, E-mail: y.komine@nano.iis.u-tokyo.ac.jp

【はじめに】MOSFET のさらなる微細化や低電圧化を実現する上で、ランダムばらつきは深刻な課題で ある. RTN は時間依存を有するドレイン電流ばらつきであり、その振幅は正規分布からはずれる[1,2]. また、従来の Bulk FET では離散不純物揺らぎ(RDF)に起因するパーコレーション効果のため、RTN の振 幅の統計分布がサブスレッショルド領域で大きな裾野をひく(非常に大きなデバイスが存在する)のに 対し、イントリンジックチャネルを有する SOI FET では裾野が小さいことがわかっている[2,3]. 一方、 強反転領域では、スクリーニング効果のため、Bulk FET でも裾野が小さいことがわかっている[3]. 本研 究では、薄い BOX を有する SOTB FET [4]と Bulk FET において、RTN の統計分布を系統的に調べた.【測 定】65nm 技術で作製した 1k Bulk nFET と 1k SOTB SOI nFET における RTN を DMA-TEG を用いて測定 した. いずれもゲート長 L は 60nm、ゲート幅 W は 120nm である. ゲートスタックは Bulk と SOTB で共 通のプロセスを用いている. サブスレッショルド領域では、Id をI_d × $\frac{L}{w}$ =100nA に設定した. 強反転領域 では、Bulk では V_d=V_g=1.2V とし、SOTB ではオーバードライブ電圧 V_{overdrive}の平均が Bulk と一致するよ うに調整した. RTN の電流振幅を、実測の S 値または gmを用いて ΔV_{th} に変換した.【結果】Fig.1 に、サブス





レッショルド領域(V_d =0.05V)で観測された Bulk と SOTB の最 大の RTN を示す. SOTB の RTN 振幅は Bulk の約半分程度 である. Figs.2-3 はサブスレショルド領域, Fig.4 は強反転 領域における ΔV_{th} の累積度数分布である. サブスレショ ルド領域では,メディアン付近では SOTB の方が ΔV_{th} が 大きい. これは SOTB では RDF の影響が小さくポテンシ ャルがほぼ一様であるため,トラップ電荷がチャネル中の どこに発生しても電流がある程度変調されるためだと考 えられる. Figs.2-3 では, SOTB と Bulk の ΔV_{th} は途中で交 差し, Bulk の方が ΔV_{th} の裾野を引いている. これはパー コレーション効果である. 一方,強反転領域では,裾野部 分が Bulk と SOTB でほぼ一致していることがわかる. これは,



強反転ではスクリーニング
効果がBulkもSOTBも同様
に起こり、RTNの影響がほ
ぼ同じになったためと考え
られる. 【謝辞】本研究の一部
は METI および NEDO から
LEAP に委託された研究の一
環として実施された.【文献】
[1] H. Miki et al., IEDM, p. 450,
2012. [2] T. Hiramoto et al.,
CICC, 5-2, 2011. [3] H. Ohno et al., Si Nano Workshop, p.33,
2014. [4] Y. Yamamoto et al.,
VLSI, p. 212, 2013.



